

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 17 年 8 月 11 日 (2005.8.11)

【公開番号】特開 2003-254729 (P2003-254729A)

【公開日】平成 15 年 9 月 10 日 (2003.9.10)

【出願番号】特願 2002-59382 (P2002-59382)

【国際特許分類第 7 版】

G 0 1 B 11/24

【F I】

G 0 1 B 11/24 A

G 0 1 B 11/24 D

G 0 1 B 11/24 K

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 1 月 18 日 (2005.1.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

干渉縞形成用の光学素子と被測定物とにより形成される干渉縞像を撮像し、該干渉縞像を基に被測定物の表面形状を解析する表面検査装置において、前記被測定物のエッジを含む領域を照明する照明光学系と、該照明光学系により照明された前記被測定物のエッジ像を撮像するエッジ像撮像手段と、該撮像されたエッジ像に基づいて前記干渉縞像の解析領域を決定する解析領域決定手段と、を備えることを特徴とする表面検査装置。

【請求項 2】

請求項 1 の解析領域決定手段は、前記光学素子の使用の有無により生じる前記干渉縞像とエッジ像との位置ずれを補正する補正手段を備えることを特徴とする表面検査装置。

【請求項 3】

請求項 1 の表面検査装置において、前記照明光学系は広帯域波長の光を発する照明光源を持つことを特徴とする表面検査装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 6】

(1) 干渉縞形成用の光学素子と被測定物とにより形成される干渉縞像を撮像し、該干渉縞像を基に被測定物の表面形状を解析する表面検査装置において、前記被測定物のエッジを含む領域を照明する照明光学系と、該照明光学系により照明された前記被測定物のエッジ像を撮像するエッジ像撮像手段と、該撮像されたエッジ像に基づいて前記干渉縞像の解析領域を決定する解析領域決定手段と、を備えることを特徴とする。

(2) (1) の解析領域決定手段は、前記光学素子の使用の有無により生じる前記干渉縞像とエッジ像との位置ずれを補正する補正手段を備えることを特徴とする。

(3) (1) の表面検査装置において、前記照明光学系は広帯域波長の光を発する照明光源を持つことを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 0 7
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正 4】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 0 8
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正 5】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 0 9
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正 6】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 1 0
【補正方法】削除
【補正の内容】